

2.6 2019年度大学院標準時間割表(S1S2)

時間	講義 (室番)	講義 (室番)	講義 (室番)	講義 (室番)	講義 (室番)
曜日	8:30 10:15	10:25 12:10	13:00 14:45	14:55 16:40	16:50 18:35
月	設計生産フィールドワークⅠ (中尾,村上,杉田,柳澤,長藤,杉上,西) 設計・生産	設計生産フィールドワークⅡ (中尾,村上,杉田,柳澤,長藤,杉上,西) 設計・生産	機械工学特別演習Ⅰ (13:00~16:00)		
火		Information and Measurement (233) (情報と計測) (ドロネー) [S1] 共通基盤	Applied Mathematics for (221) Mechanical Engineering (機械系応用数学) (高木) [S1] 共通基盤	Molecular Thermo-Fluid (222) Engineering (分子熱流体工学) (塩見,杵淵) 熱・流体	機械工学特別演習Ⅰ (16:50~18:20)
		弾性学 (222) (吉川,梅野,波田野) [S1] 固体・材料	Advanced Lectures on Mechanical (221) Engineering II (機械工学特別講義Ⅱ) (高木,Viklund) [S2]		
	機械力学・制御概論 (223) (須田,中野,山川) 機力・制御	塑性学 (222) (柳本,泉) [S2] 固体・材料	Distributed Energy System (223) - Modeling and Design (分散型エネルギーシステム -モデル化と設計-) (山崎,坂東) 機力・制御		
			実践的シミュレーションソフトウェア開発演習 (231) (加藤,佐藤,居駒,高橋(英),西村,平野)		
水	機械設計学 (223) (村上,山中,柳澤) 設計・生産	機械系数値解析法 (212) (志賀,守) 共通基盤		トライボロジー (222) (崔,加納,是永) 固体・材料	
				熱工学特論 (223) (白樫) 熱・流体	
			アカデミック・ライティング アカデミック・プレゼンテーション (森村)【工共通科目】 共通基盤	工学リテラシーⅠ ※ (212) -イノベーションと技術マネジメント- (丸山,大久保,横野)	エネルギーと社会 (221) (浅野,鹿園他) 【工共通科目】 熱・流体
木		自動車工学 (233) (鎌田,小竹,山崎) 機力・制御	機械力学・制御演習 (223) (山崎,小竹,山川) 機力・制御		機械工学特別演習Ⅰ (16:50~18:20)
		ナノ・マイクロ医療システム (222) (光石他) バイオ	生体流体力学 (222) (大島) [S1] バイオ	バイオマニピュレーション工学 (222) (白樫,小穴) バイオ	
			バイオトランスファー (222) (白樫) [S2] バイオ		
金		Information and Measurement (233) (情報と計測) (ドロネー) [S1] 共通基盤	Applied Mathematics for (221) Mechanical Engineering (機械系応用数学) (高木) [S1] 共通基盤	エネルギー変換工学 (223) (加藤,鹿園,幸田) 熱・流体	技術の管理 (221) (中尾,長藤) 設計・生産
			Advanced Lectures on Mechanical (221) Engineering II (機械工学特別講義Ⅱ) (高木,Viklund) [S2]	弾性学 (222) (吉川,梅野,波田野) [S1] 固体・材料	
				塑性学 (222) (柳本,泉) [S2] 固体・材料	
		再生医工学 (223) (牛田,古川,モンターニュ) バイオ		Mechano-Bioengineering (233) (メカノバイオエンジニアリング) (古川,牛田,光石,高木) バイオ	

●機械工学特別講義Ⅲ(長谷川,中山)は通年の集中講義方式で行われます。日程は決定次第揭示します。

●拡張ナノ空間実践演習(光石,丸山,三田)※・工学コンピテンシーⅢ-サマー・キャンプ-(渡邊(聡),光石,丸山,横野,原田,モンターニュ,田他)共通基盤・非線形有限要素法の原理と応用(泉,渡邊(浩),波田野,伊田)固体・材料
・臨床バイオメカニクス(光石,橋詰他)バイオはS1S2学期中に集中講義方式で行われます。日程は決定次第揭示します。

●工学コンピテンシーⅡ-研究インターンシップ-(高増,横野,吉江)共通基盤・工学リテラシーⅢ-アドバンス・アカデミック・プレゼンテーション-(光石,横野,森村,秋山)※・長期インターンシップ(塩見,杵淵)共通基盤(については、別途指示があります。

注) ※は博士課程学生のみ対象

注) 設計生産フィールドワークⅠと設計生産フィールドワークⅡは同時に履修すること